



检测报告

报告编号 A2190339094179CQa001

第 1 页 共 44 页

委托单位 无锡华润上华科技有限公司

受检单位 无锡华润上华科技有限公司

受检单位地址 无锡市新吴区新洲路 8 号

样品类型 工业废气

报告用途 自检

苏州市华测检测技术有限公司

检验检测专用章

No.188426A197

报告说明

报告编号 A2190339094179CQa001

第 2 页 共 44 页

1. 本报告不得涂改、增删，无签发人签字无效。
2. 本报告无检验检测专用章、骑缝章无效。
3. 未经 CTI 书面批准，不得部分复制检测报告。
4. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
5. 现场运行设备设施参数由客户提供。标准限值由客户提供；分析方法、频次与标准不一致时，检测结果作参考使用。
6. 除客户特别声明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再留样。
7. 对本报告有疑议，请在收到报告 10 天之内与本公司联系。

苏州市华测检测技术有限公司

联系地址：江苏省苏州市相城区澄阳路 3286 号

邮政编码：215134

编制：

程号玉

审核：

戴利利

签发：

邹锋

签发人姓名：

邹锋

签发日期：

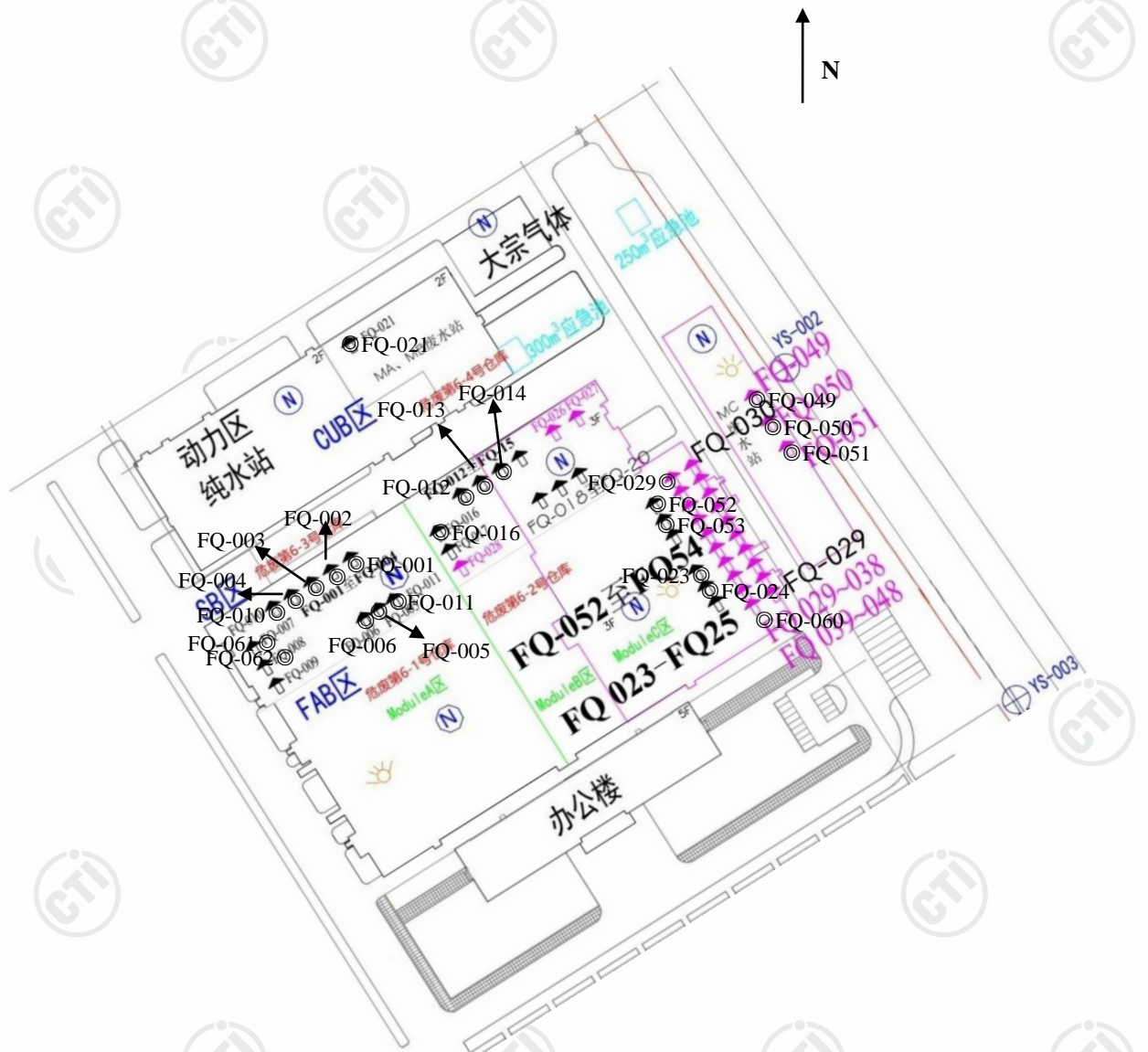
2023/09/06

主要参数与检测结果

报告编号 A2190339094179CQa001

第 3 页 共 44 页

附：检测布点图



说明：◎工业废气有组织采样点

本页完

主要参数与检测结果

报告编号 A2190339094179CQa001

第 4 页 共 44 页

表 1:

样品信息:								
样品类型	工业废气 (有组织)							
采样日期	2023-08-23、2023-08-24			检测日期	2023-08-23~2023-08-29			
采样方式	连续			样品状态	完好			
检测结果:								
点位名称	检测项目	样品编号	排放浓度 mg/m ³	排放速率 kg/h	标干流量 m ³ /h	参照标准限值		排气筒高度 m
						排放浓度 mg/m ³	排放速率 kg/h	
FQ-001	氮氧化物 (2023-08-23)	SUP73148016	4	/	44399	50 ^a	---	33.5
		SUP73148017	ND					
		SUP73148018	ND					
		平均值	ND					
	氯化氢 (2023-08-23)	SUP73148004	0.75	3.42×10 ⁻²	43908	10	---	
		SUP73148005	0.76					
		SUP73148006	0.84					
		平均值	0.78					
	氯气 (2023-08-23)	SUP73148013	1.5	5.81×10 ⁻²	44658	5.0	---	
		SUP73148014	1.1					
		SUP73148015	1.2					
		平均值	1.3					
	硫酸雾 (2023-08-23)	SUP73148010	0.44	1.42×10 ⁻²	44442	5.0	---	
		SUP73148011	0.42					
		SUP73148012	ND					
		平均值	0.32					
	氟化物 (2023-08-24)	SUP73148376	0.40	1.51×10 ⁻²	39716	1.5	---	
		SUP73148377	0.38					
		SUP73148378	0.35					
		平均值	0.38					

本页完

主要参数与检测结果

报告编号 A2190339094179CQa001

第 5 页 共 44 页

续上表

烟气参数:					
烟气参数	烟温 °C	流速 m/s	大气压 kPa	截面 m ²	标干流量 m ³ /h
SUP73148004/010 /013	32	10.8	100.3	1.3273	43787
SUP73148005/011 /016/017	31	10.7	100.4	1.3273	43658
SUP73148006/014	32	10.9	100.3	1.3273	44280
SUP73148012/018	32	11.3	100.3	1.3273	45882
SUP73148015	31	11.3	100.3	1.3273	45906
SUP73148376	25	9.8	100.5	1.3273	40728
SUP73148377	25	9.3	100.5	1.3273	38640
SUP73148378	24	9.6	100.5	1.3273	39781
参照标准	《半导体行业污染物排放标准》(DB32/3747-2020) 表 3 大气污染物排放限值				
备注: 1. FQ-001 管道直径 1.30m, 采样孔位于风机下游 300cm, 位于排气口上游 430cm, 采样孔直径 10cm。 2.a 表示适用于酸洗、薄膜等工段产生的工艺废气。 3. 氮氧化物为现场检测。 4. "ND" 表示未检出, 涉及项目检出限详见表 26。 5. "/" 表示检测项目的排放浓度小于检出限, 故排放速率无需计算。 6. "---" 表示 DB 32/3747-2020 表 3 标准中未对该项目作限制。					

本页完

主要参数与检测结果

报告编号 A2190339094179CQa001

第 6 页 共 44 页

表 2:

样品信息:								
样品类型	工业废气 (有组织)							
采样日期	2023-08-23、2023-08-24			检测日期	2023-08-23~2023-08-29			
采样方式	连续			样品状态	完好			
检测结果:								
点位名称	检测项目	样品编号	排放浓度 mg/m ³	排放速率 kg/h	标干流量 m ³ /h	参照标准限值		排气筒高度 m
						排放浓度 mg/m ³	排放速率 kg/h	
FQ-002	氮氧化物 (2023-08-23)	SUP73148034	19	0.759	50577	50 ^a	---	33.5
		SUP73148035	25					
		SUP73148036	ND					
		平均值	15					
	氯化氢 (2023-08-23)	SUP73148043	0.82	3.30×10 ⁻²	47147	10	---	
		SUP73148044	0.59					
		SUP73148045	0.70					
		平均值	0.70					
	氯气 (2023-08-23)	SUP73148046	2.0	7.88×10 ⁻²	46330	5.0	---	
		SUP73148047	1.4					
		SUP73148048	1.8					
		平均值	1.7					
	硫酸雾 (2023-08-23)	SUP73148040	0.27	/	47147	5.0	---	
		SUP73148041	ND					
		SUP73148042	ND					
		平均值	ND					
	氟化物 (2023-08-24)	SUP73148379	0.50	3.16×10 ⁻²	53539	1.5	---	
		SUP73148380	0.57					
		SUP73148381	0.69					
		平均值	0.59					

本页完

主要参数与检测结果

报告编号 A2190339094179CQa001

第 7 页 共 44 页

续上表

烟气参数:					
烟气参数	烟温 °C	流速 m/s	大气压 kPa	截面 m ²	标干流量 m ³ /h
SUP73148034/035/047	21	11.8	100.4	1.3273	50292
SUP73148036	20	12.0	100.4	1.3273	51147
SUP73148040/043/046	21	8.5	100.4	1.3273	36223
SUP73148041/044	21	13.2	100.4	1.3273	56216
SUP73148042/045	21	11.5	100.4	1.3273	49003
SUP73148048	20	12.3	100.4	1.3273	52476
SUP73148379	20	13.1	100.6	1.3273	55951
SUP73148380	20	12.1	100.6	1.3273	51659
SUP73148381	20	12.4	100.6	1.3273	53007
参照标准	《半导体行业污染物排放标准》(DB32/3747-2020) 表 3 大气污染物排放限值				
备注: 1. FQ-002 管道直径 1.30m, 采样孔位于风机下游 300cm, 位于排气口上游 430cm, 采样孔直径 10cm。 2.a 表示适用于酸洗、薄膜等工段产生的工艺废气。 3. 氮氧化物为现场检测。 4. “ND”表示未检出, 涉及项目检出限详见表 26。 5. “/”表示检测项目的排放浓度小于检出限, 故排放速率无需计算。 6. “---”表示 DB 32/3747-2020 表 3 标准中未对该项目作限制。					

本页完

主要参数与检测结果

报告编号 A2190339094179CQa001

第 8 页 共 44 页

表 3:

样品信息:								
样品类型		工业废气 (有组织)						
采样日期		2023-08-23、2023-08-24		检测日期		2023-08-23~2023-08-29		
采样方式		连续		样品状态		完好		
检测结果:								
点位名称	检测项目	样品编号	排放浓度 mg/m ³	排放速率 kg/h	标干流 量 m ³ /h	参照标准限值		排气 筒高 度 m
						排放浓 度 mg/m ³	排放 速率 kg/h	
FQ-003	氮氧化物 (2023-08-23)	SUP73148019	ND	/	45168	50 ^a	---	33.5
		SUP73148020	ND					
		SUP73148021	ND					
		平均值	ND					
	氯化氢 (2023-08-23)	SUP73148028	0.88	3.03×10 ⁻²	45168	10	---	
		SUP73148029	0.48					
		SUP73148030	0.64					
		平均值	0.67					
	氯气 (2023-08-23)	SUP73148031	1.1	6.20×10 ⁻²	44290	5.0	---	
		SUP73148032	1.5					
		SUP73148033	1.5					
		平均值	1.4					
	硫酸雾 (2023-08-23)	SUP73148025	ND	/	44718	5.0	---	
		SUP73148026	ND					
		SUP73148027	0.36					
		平均值	ND					
	氟化物 (2023-08-24)	SUP73148382	0.34	1.80×10 ⁻²	48733	1.5	---	
		SUP73148383	0.37					
		SUP73148384	0.40					
		平均值	0.37					

本页完

主要参数与检测结果

报告编号 A2190339094179CQa001

第 9 页 共 44 页

续上表

烟气参数:					
烟气参数	烟温℃	流速 m/s	大气压 kPa	截面 m ²	标干流量 m ³ /h
SUP73148019/025/ 028/028/031	35	10.9	100.3	1.3273	43553
SUP73148020/021/ 026/029/030	36	11.5	100.3	1.3273	45975
SUP73148027	36	11.2	100.3	1.3273	44627
SUP73148032	37	11.5	100.3	1.3273	45534
SUP73148033	35	10.9	100.3	1.3273	43782
SUP73148382	16	11.4	100.5	1.3273	48740
SUP73148383	16	11.7	100.5	1.3273	49804
SUP73148384	19	11.3	100.5	1.3273	47655
参照标准	《半导体行业污染物排放标准》(DB 32/3747-2020) 表 3				
备注: 1. FQ-003 管道直径 1.30m, 采样孔位于风机下游 300cm, 位于排气口上游 430cm, 采样孔直径 10cm。 2.a 表示适用于酸洗、薄膜等工段产生的工艺废气。 3. 氮氧化物为现场检测。 4. "ND" 表示未检出, 涉及项目检出限详见表 26。 5. "/" 表示检测项目的排放浓度小于检出限, 故排放速率无需计算。 6. "---" 表示 DB 32/3747-2020 表 3 标准中未对该项目作限制。					

本页完

主要参数与检测结果

报告编号 A2190339094179CQa001

第 10 页 共 44 页

表 4:

样品信息:								
样品类型	工业废气 (有组织)							
采样日期	2023-08-23、2023-08-24			检测日期	2023-08-23~2023-08-29			
采样方式	连续			样品状态	完好			
检测结果:								
点位名称	检测项目	样品编号	排放浓度 mg/m ³	排放速率 kg/h	标干流量 m ³ /h	参照标准限值		排气筒高度 m
						排放浓度 mg/m ³	排放速率 kg/h	
FQ-004	氮氧化物 (2023-08-23)	SUP73148049	7	0.164	27382	50 ^a	---	33.5
		SUP73148050	10					
		SUP73148051	ND					
		平均值	6					
	氯化氢 (2023-08-23)	SUP73148058	0.60	1.78×10 ⁻²	28263	10	---	
		SUP73148059	0.90					
		SUP73148060	0.39					
		平均值	0.63					
	氯气 (2023-08-23)	SUP73148061	2.2	4.35×10 ⁻²	28987	5.0	---	
		SUP73148062	1.3					
		SUP73148063	1.1					
		平均值	1.5					
	硫酸雾 (2023-08-23)	SUP73148055	0.52	1.32×10 ⁻²	27520	5.0	---	
		SUP73148056	0.52					
		SUP73148057	0.39					
		平均值	0.48					
	氟化物 (2023-08-24)	SUP73148385	0.66	1.83×10 ⁻²	30421	1.5	---	
		SUP73148386	0.61					
		SUP73148387	0.52					
		平均值	0.60					

本页完

主要参数与检测结果

报告编号 A2190339094179CQa001

第 11 页 共 44 页

续上表

烟气参数:					
烟气参数	烟温 °C	流速 m/s	大气压 kPa	截面 m ²	标干流量 m ³ /h
SUP73148049/050 /056/059/060	21	6.6	100.4	1.3273	28125
SUP73148051/057	22	6.1	100.4	1.3273	25895
SUP73148055/058 /061	21	6.7	100.4	1.3273	28540
SUP73148062	23	6.4	100.4	1.3273	27116
SUP73148063	23	7.4	100.4	1.3273	31304
SUP73148385	20	7.4	100.6	1.3273	31717
SUP73148386	20	6.7	100.6	1.3273	28698
SUP73148387	20	7.2	100.6	1.3273	30848
参照标准	《半导体行业污染物排放标准》(DB32/3747-2020) 表 3 大气污染物排放限值				
备注: 1.FQ-004 管道直径 1.30m, 采样孔位于风机下游 300cm, 位于排气口上游 430cm, 采样孔直径 10cm。 2.a 表示适用于酸洗、薄膜等工段产生的工艺废气。 3.氮氧化物为现场检测。 4.“---”表示 DB 32/3747-2020 表 3 标准中未对该项目作限制。 5.排气筒高度由受检单位提供。 6.“ND”表示未检出, 涉及项目检出限详见表 26。					

本页完

主要参数与检测结果

报告编号 A2190339094179CQa001

第 12 页 共 44 页

表 5:

样品信息:								
样品类型		工业废气 (有组织)						
采样日期		2023-08-24		检测日期		2023-08-25		
采样方式		连续		样品状态		完好		
检测结果:								
点位名称	检测项目	样品编号	排放浓度 mg/m ³	排放速率 kg/h	标干流量 m ³ /h	参照标准限值		排气筒 高度 m
						排放浓度 mg/m ³	排放速率 kg/h	
FQ-005	氨	SUP73148127	0.27	4.83×10 ⁻³	15103	10	---	33.5
		SUP73148128	0.29					
		SUP73148129	0.39					
		平均值	0.32					
烟气参数:								
烟气参数	烟温 °C	流速 m/s	大气压 kPa	截面 m ²	标干流量 m ³ /h			
SUP73148127	20	6.2	100.7	0.7854	15898			
SUP73148128	20	6.1	100.7	0.7854	15623			
SUP73148129	20	5.4	100.6	0.7854	13787			
参照标准	《半导体行业污染物排放标准》(DB/3747-2020) 表 3 大气污染物排放限值							
备注: 1.“---”表示 DB/3747-2020 表 3 标准中未对该项目作限制。								
2.FQ-005 管道直径 1.00m, 采样孔位于变径处下游 400cm, 采样孔直径 10cm。								

本页完

主要参数与检测结果

报告编号 A2190339094179CQa001

第 13 页 共 44 页

表 6:

样品信息:								
样品类型		工业废气 (有组织)						
采样日期		2023-08-24		检测日期		2023-08-25		
采样方式		连续		样品状态		完好		
检测结果:								
点位名称	检测项目	样品编号	排放浓度 mg/m ³	排放速率 kg/h	标干流量 m ³ /h	参照标准限值		排气筒 高度 m
						排放浓度 mg/m ³	排放速率 kg/h	
FQ-006	氨	SUP73148130	0.58	7.02×10 ⁻³	14945	10	---	33.5
		SUP73148131	0.49					
		SUP73148132	0.33					
		平均值	0.47					
烟气参数:								
烟气参数	烟温 °C	流速 m/s	大气压 kPa	截面 m ²	标干流量 m ³ /h			
SUP73148130	21	6.2	100.8	0.7854	15810			
SUP73148131	21	5.9	100.7	0.7854	15031			
SUP73148132	21	5.5	100.6	0.7854	13995			
参照标准	《半导体行业污染物排放标准》(DB/3747-2020) 表 3 大气污染物排放限值							
备注: 1.“---”表示 DB/3747-2020 表 3 标准中未对该项目作限制。								
2.FQ-006 管道直径 1.00m, 采样孔位于变径处下游 400cm, 采样孔直径 10cm。								

主要参数与检测结果

报告编号 A2190339094179CQa001

第 14 页 共 44 页

表 7:

样品信息:								
样品类型	工业废气 (有组织)							
采样日期	2023-08-23	检测日期	2023-08-23~2023-08-29					
采样方式	连续	样品状态	完好					
检测结果:								
点位名称	检测项目	样品编号	排放浓度 mg/m ³	排放速率 kg/h	标干流 量 m ³ /h	参照标准限值		排气 筒高 度 m
						排放浓 度 mg/m ³	排放 速率 kg/h	
FQ-010	氟化物	SUP73148067	0.32	1.88×10 ⁻²	64825	1.5	---	33.5
		SUP73148068	0.25					
		SUP73148069	0.29					
		平均值	0.29					
	氮氧化物	SUP73148064	ND	/	64825	50 ^a	---	
		SUP73148065	3					
		SUP73148066	ND					
		平均值	ND					
	氯化氢	SUP73148073	0.51	3.78×10 ⁻²	66379	10	---	
		SUP73148074	0.60					
		SUP73148075	0.59					
		平均值	0.57					
	氯气	SUP73148076	1.5	8.36×10 ⁻²	64300	5.0	---	
		SUP73148077	1.1					
		SUP73148078	1.3					
		平均值	1.3					
	硫酸雾	SUP73148070	0.31	2.57×10 ⁻²	65798	5.0	---	
		SUP73148071	0.23					
		SUP73148072	0.64					
		平均值	0.39					

本页完

主要参数与检测结果

报告编号 A2190339094179CQa001

第 15 页 共 44 页

续上表

烟气参数:					
烟气参数	烟温 °C	流速 m/s	大气压 kPa	截面 m ²	标干流量 m ³ /h
SUP73148064/067 /078	27	15.3	100.3	1.3273	62885
SUP73148070/073 /076	26	15.6	100.3	1.3273	64381
SUP73148066/069	27	15.9	100.3	1.3273	65582
SUP73148072/077	27	15.9	100.3	1.3273	65634
SUP73148065/068	27	16.0	100.3	1.3273	66008
SUP73148071/074 /075	27	16.3	100.3	1.3273	67378
参照标准	《半导体行业污染物排放标准》(DB 32/3747-2020) 表 3				
备注: 1.FQ-010 管道直径 1.30m, 采样孔位于弯道下游 300cm, 位于排气口上游 430cm, 采样孔直径 12cm。 2.a 表示适用于酸洗、薄膜等工段产生的工艺废气。 3.氮氧化物为现场检测。 4.“--”表示 DB 32/3747-2020 表 3 标准中未对该项目作限制。 5.“ND”表示未检出, 涉及项目检出限详见表 26。 6.“/”表示检测项目的排放浓度小于检出限, 故排放速率无需计算。					

本页完

主要参数与检测结果

报告编号 A2190339094179CQa001

第 16 页 共 44 页

表 8:

样品信息:								
样品类型	工业废气 (有组织)							
采样日期	2023-08-24	检测日期	2023-08-25					
采样方式	连续	样品状态	完好					
检测结果:								
点位名称	检测项目	样品编号	排放浓度 mg/m ³	排放速率 kg/h	标干流量 m ³ /h	参照标准限值		排气筒 高度 m
						排放浓度 mg/m ³	排放速率 kg/h	
FQ-011	氨	SUP73148124	ND	7.82×10 ⁻³	16295	10	---	33.5
		SUP73148125	0.42					
		SUP73148126	0.88					
		平均值	0.48					
烟气参数:								
烟气参数	烟温 °C	流速 m/s	大气压 kPa	截面 m ²	标干流量 m ³ /h			
SUP73148124	19	7.2	100.7	0.7854	18475			
SUP73148125	19	6.6	100.7	0.7854	16921			
SUP73148126	21	5.3	100.6	0.7854	13489			
参照标准	《半导体行业污染物排放标准》(DB/3747-2020) 表 3 大气污染物排放限值							
备注: 1.“ND”表示未检出, 涉及项目检出限详见表 26。								
2.“---”表示 DB/3747-2020 表 3 标准中未对该项目作限制。								
3.FQ-011 管道直径 1.00m, 采样孔位于变径处下游 400cm, 采样孔直径 10cm。								

本页完

主要参数与检测结果

报告编号 A2190339094179CQa001

第 17 页 共 44 页

表 9:

样品信息:								
样品类型	工业废气 (有组织)							
采样日期	2023-08-24	检测日期	2023-08-24~2023-08-31					
采样方式	连续	样品状态	完好					
检测结果:								
点位名称	检测项目	样品编号	排放浓度 mg/m ³	排放速率 kg/h	标干流量 m ³ /h	参照标准限值		排气筒高度 m
						排放浓度 mg/m ³	排放速率 kg/h	
FQ-012	氟化物	SUP73148082	0.50	1.36×10 ⁻²	29596	1.5	---	33.5
		SUP73148083	0.40					
		SUP73148084	0.48					
		平均值	0.46					
	氮氧化物	SUP73148079	ND	/	28472	50 ^a	---	
		SUP73148080	ND					
		SUP73148081	ND					
		平均值	ND					
	氯化氢	SUP73148088	0.54	3.09×10 ⁻²	29734	10	---	
		SUP73148089	1.52					
		SUP73148090	1.07					
		平均值	1.04					
	氯气	SUP73148091	2.7	6.23×10 ⁻²	28315	5.0	---	
		SUP73148092	2.2					
		SUP73148093	1.6					
		平均值	2.2					
	硫酸雾	SUP73148085	0.70	1.99×10 ⁻²	29734	5.0	---	
		SUP73148086	0.92					
		SUP73148087	0.40					
		平均值	0.67					

本页完

主要参数与检测结果

报告编号 A2190339094179CQa001

第 18 页 共 44 页

续上表

烟气参数:					
烟气参数	烟温 °C	流速 m/s	大气压 kPa	截面 m ²	标干流量 m ³ /h
SUP73148079/080 /085/088/091	20	6.4	100.7	1.3273	27335
SUP73148084/093	20	6.7	100.7	1.3273	28613
SUP73148082/092	21	6.8	100.7	1.3273	28996
SUP73148081/086 /089	20	7.2	100.7	1.3273	30745
SUP73148087/090	21	7.3	100.7	1.3273	31121
SUP73148083	20	7.3	100.7	1.3273	31180
参照标准	《半导体行业污染物排放标准》(DB 32/3747-2020) 表 3 大气污染物排放限值				
备注: 1.FQ-012 管道直径 1.30m, 采样孔位于风机下游 360cm, 位于排气口上游 430cm, 采样孔直径 10cm。 2.a 表示适用于酸洗、薄膜等工段产生的工艺废气。 3.氮氧化物为现场检测。 4.“ND”表示未检出, 涉及项目检出限详见表 26。 5.“/”表示检测项目的排放浓度小于检出限, 故排放速率无需计算。 6.“---”表示 DB 32/3747-2020 表 3 标准中未对该项目作限制。					

本页完

主要参数与检测结果

报告编号 A2190339094179CQa001

第 19 页 共 44 页

表 10:

样品信息:								
样品类型	工业废气 (有组织)							
采样日期	2023-08-24	检测日期	2023-08-24~2023-08-31					
采样方式	连续	样品状态	完好					
检测结果:								
点位名称	检测项目	样品编号	排放浓度 mg/m ³	排放速率 kg/h	标干流量 m ³ /h	参照标准限值		排气筒高度 m
						排放浓度 mg/m ³	排放速率 kg/h	
FQ-013	氟化物	SUP73148097	0.44	1.53×10 ⁻²	31209	1.5	---	33.5
		SUP73148098	0.58					
		SUP73148099	0.46					
		平均值	0.49					
	氮氧化物	SUP73148094	ND	/	33901	50 ^a	---	
		SUP73148095	ND					
		SUP73148096	ND					
		平均值	ND					
	氯化氢	SUP73148103	1.46	7.32×10 ⁻²	33748	10	---	
		SUP73148104	3.75					
		SUP73148105	1.31					
		平均值	2.17					
	氯气	SUP73148106	2.1	5.90×10 ⁻²	32756	5.0	---	
		SUP73148107	1.5					
		SUP73148108	1.7					
		平均值	1.8					
	硫酸雾	SUP73148100	0.22	1.01×10 ⁻²	33748	5.0	---	
		SUP73148101	0.57					
		SUP73148102	ND					
		平均值	0.30					

本页完

主要参数与检测结果

报告编号 A2190339094179CQa001

第 20 页 共 44 页

续上表

烟气参数:					
烟气参数	烟温 °C	流速 m/s	大气压 kPa	截面 m ²	标干流量 m ³ /h
SUP73148096/101 /104	24	8.3	100.6	1.3273	35033
SUP73148099/108	24	8.2	100.6	1.3273	34618
SUP73148094/095 /100/103/106	25	7.9	100.7	1.3273	33335
SUP73148102/105	25	7.8	100.6	1.3273	32877
SUP73148097/107	25	7.2	100.6	1.3273	30316
SUP73148098	24	6.8	100.6	1.3273	28693
参照标准	《半导体行业污染物排放标准》(DB 32/3747-2020) 表 3 大气污染物排放限值				
备注: 1.FQ-013 管道直径 1.30m, 采样孔位于风机下游 360cm, 位于排气口上游 430cm, 采样孔直径 10cm。 2.a 表示适用于酸洗、薄膜等工段产生的工艺废气。 3.氮氧化物为现场检测。 4.“ND”表示未检出, 涉及项目检出限详见表 26。 5.“/”表示检测项目的排放浓度小于检出限, 故排放速率无需计算。 6.“---”表示 DB 32/3747-2020 表 3 标准中未对该项目作限制。					

本页完

主要参数与检测结果

报告编号 A2190339094179CQa001

第 21 页 共 44 页

表 11:

样品信息:								
样品类型	工业废气 (有组织)							
采样日期	2023-08-24	检测日期	2023-08-24~2023-08-31					
采样方式	连续	样品状态	完好					
检测结果:								
点位名称	检测项目	样品编号	排放浓度 mg/m ³	排放速率 kg/h	标干流量 m ³ /h	参照标准限值		排气筒高度 m
						排放浓度 mg/m ³	排放速率 kg/h	
FQ-014	氟化物	SUP73148112	0.54	1.90×10 ⁻²	31680	1.5	---	33.5
		SUP73148113	0.71					
		SUP73148114	0.56					
		平均值	0.60					
	氮氧化物	SUP73148109	3	/	30850	50 ^a	---	
		SUP73148110	ND					
		SUP73148111	ND					
		平均值	ND					
	氯化氢	SUP73148118	1.06	2.69×10 ⁻²	30929	10	---	
		SUP73148119	0.83					
		SUP73148120	0.71					
		平均值	0.87					
	氯气	SUP73148121	1.3	5.98×10 ⁻²	31488	5.0	---	
		SUP73148122	2.2					
		SUP73148123	2.3					
		平均值	1.9					
	硫酸雾	SUP73148115	0.48	2.26×10 ⁻²	30994	5.0	---	
		SUP73148116	0.81					
		SUP73148117	0.89					
		平均值	0.73					

本页完

主要参数与检测结果

报告编号 A2190339094179CQa001

第 22 页 共 44 页

续上表

烟气参数:					
烟气参数	烟温 °C	流速 m/s	大气压 kPa	截面 m ²	标干流量 m ³ /h
SUP73148109/110 /115/118/121	30	7.5	100.6	1.3273	30641
SUP73148116/119 /120	30	7.6	100.7	1.3273	31073
SUP73148113	30	7.6	100.7	1.3273	31217
SUP73148112/122	30	7.6	100.7	1.3273	31250
SUP73148111/117	31	7.7	100.7	1.3273	31267
SUP73148114/123	31	8.0	100.6	1.3273	32572
参照标准	《半导体行业污染物排放标准》(DB 32/3747-2020) 表 3 大气污染物排放限值				
备注: 1.FQ-014 管道直径 1.30m, 采样孔位于风机下游 300cm, 位于排气口上游 430cm, 采样孔直径 10cm。 2.a 表示适用于酸洗、薄膜等工段产生的工艺废气。 3.氮氧化物为现场检测。 4.“ND”表示未检出, 涉及项目检出限详见表 26。 5.“/”表示检测项目的排放浓度小于检出限, 故排放速率无需计算。 6.“---”表示 DB 32/3747-2020 表 3 标准中未对该项目作限制。					

本页完

主要参数与检测结果

报告编号 A2190339094179CQa001

第 23 页 共 44 页

表 12:

样品信息:								
样品类型	工业废气 (有组织)							
采样日期	2023-08-24	检测日期	2023-08-25					
采样方式	连续	样品状态	完好					
检测结果:								
点位名称	检测项目	样品编号	排放浓度 mg/m ³	排放速率 kg/h	标干流量 m ³ /h	参照标准限值		排气筒 高度 m
						排放浓度 mg/m ³	排放速率 kg/h	
FQ-016	氨	SUP73148133	ND	6.60×10 ⁻³	21991	10	---	33.5
		SUP73148134	0.32					
		SUP73148135	0.47					
		平均值	0.30					
烟气参数:								
烟气参数	烟温 °C	流速 m/s	大气压 kPa	截面 m ²	标干流量 m ³ /h			
SUP73148133	19	8.4	100.7	0.7854	21609			
SUP73148134	19	8.8	100.7	0.7854	22607			
SUP73148135	20	8.5	100.6	0.7854	21758			
参照标准	《半导体行业污染物排放标准》(DB/3747-2020) 表 3 大气污染物排放限值							
备注: 1 “ND”表示未检出, 涉及项目检出限详见表 26。								
2.“---”表示 DB/3747-2020 表 3 标准中未对该项目作限制。								
3. FQ-016 管道直径 1.00m, 采样孔位于弯道下游 400cm, 采样孔直径 10cm。								

本页完

主要参数与检测结果

报告编号 A2190339094179CQa001

第 24 页 共 44 页

表 13:

样品信息:								
样品类型	工业废气 (有组织)							
采样日期	2023-08-25	检测日期	2023-08-26~2023-08-30					
采样方式	连续	样品状态	完好					
检测结果:								
点位名称	检测项目	样品编号	排放浓度 mg/m ³	排放速率 kg/h	标干流 量 m ³ /h	参照标准限值		排气 筒高 度 m
						排放浓 度 mg/m ³	排放 速率 kg/h	
FQ-021(DA001)	氯化氢	SUP73148001	1.74	1.24×10 ⁻²	3584	10	---	33
		SUP73148002	5.35					
		SUP73148003	3.25					
		平均值	3.45					
烟气参数:								
烟气参数	烟温℃	流速 m/s	大气压 kPa	截面 m ²	标干流量 m ³ /h			
SUP73148001	26	2.2	100.6	0.5027	3478			
SUP73148002	26	2.3	100.6	0.5027	3638			
SUP73148003	26	2.3	100.6	0.5027	3636			
参照标准	《半导体行业污染物排放标准》(DB 32/3747-2020) 表 3 大气污染物排放限值							
备注: “---”表示 DB 32/3747-2020 表 3 标准中未对该项目作限制。								

本页完

主要参数与检测结果

报告编号 A2190339094179CQa001

第 25 页 共 44 页

表 14:

样品信息:								
样品类型	工业废气 (有组织)							
采样日期	2023-08-25	检测日期	2023-08-25~2023-08-30					
采样方式	连续/瞬时	样品状态	完好					
检测结果:								
点位名称	检测项目	样品编号	排放浓度 mg/m ³	排放速率 kg/h	标干流 量 m ³ /h	参照标准限值		排气 筒高 度 m
						排放浓 度 mg/m ³	排放 速率 kg/h	
FQ-023	异丙醇	SUP73148202	ND	2.34×10 ⁻³	25484	40	---	33.5
		SUP73148203	0.054					
		SUP73148204	0.222					
		平均值	0.092					
	非甲烷总 烃	SUP73148199	1.13	4.94×10 ⁻²	25484	50	---	
		SUP73148200	2.30					
		SUP73148201	2.40					
		平均值	1.94					
	二氧化硫	SUP73148196	ND	/	25484	200	1.4	
		SUP73148197	ND					
		SUP73148198	ND					
		平均值	ND					
	氮氧化物	SUP73148196	3	0.102	25484	100	0.47	
		SUP73148197	4					
		SUP73148198	5					
		平均值	4					
	颗粒物	SUP73148205	2.8	5.82×10 ⁻²	24244	20	1	
		SUP73148206	2.2					
		SUP73148207	2.1					
		平均值	2.4					

本页完

主要参数与检测结果

报告编号 A2190339094179CQa001

第 26 页 共 44 页

续上表

烟气参数:					
烟气参数	烟温 °C	流速 m/s	大气压 kPa	截面 m ²	标干流量 m ³ /h
SUP73148196/197/ 198/199/200/201/20 2/203/204/205	57	11.1	100.6	0.7854	25484
SUP73148206	57	10.6	100.5	0.7854	24326
SUP73148207	54	9.9	100.5	0.7854	22922
参照标准	二氧化硫、氮氧化物、颗粒物: 《大气污染物综合排放标准》(DB 32/4041-2021) 表 1 大气污染物有组织排放限值 异丙醇、非甲烷总烃: 《半导体行业污染物排放标准》(DB 32/3747-2020) 表 3 大气 污染物排放限值				
备注: 1.“ND”表示未检出, 涉及项目检出限详见表 26。 2.“/”表示检测项目的排放浓度小于检出限, 故排放速率无需计算。 3.“---”表示 DB 32/3747-2020 表 3 标准中未对该项目作限制。 4.二氧化硫、氮氧化物为现场检测。					

本页完

主要参数与检测结果

报告编号 A2190339094179CQa001

第 27 页 共 44 页

表 15:

样品信息:								
样品类型	工业废气 (有组织)							
采样日期	2023-08-25	检测日期	2023-08-25~2023-08-30					
采样方式	连续/瞬时	样品状态	完好					
检测结果:								
点位名称	检测项目	样品编号	排放浓度 mg/m ³	排放速率 kg/h	标干流 量 m ³ /h	参照标准限值		排气 筒高 度 m
						排放浓 度 mg/m ³	排放 速率 kg/h	
FQ-024	异丙醇	SUP73148214	ND	1.53×10 ⁻³	17779	40	---	33.5
		SUP73148215	0.163					
		SUP73148216	0.095					
		平均值	0.086					
	非甲烷总 烃	SUP73148211	1.17	2.17×10 ⁻²	17779	50	---	
		SUP73148212	1.40					
		SUP73148213	1.09					
		平均值	1.22					
	二氧化硫	SUP73148208	ND	/	17779	200	1.4	
		SUP73148209	ND					
		SUP73148210	ND					
		平均值	ND					
	氮氧化物	SUP73148208	5	7.11×10 ⁻²	17779	100	0.47	
		SUP73148209	6					
		SUP73148210	ND					
		平均值	4					
颗粒物	SUP73148217	2.3	4.81×10 ⁻²	17829	20	1		
	SUP73148218	2.8						
	SUP73148219	3.0						
	平均值	2.7						

本页完

主要参数与检测结果

报告编号 A2190339094179CQa001

第 28 页 共 44 页

续上表

烟气参数:					
烟气参数	烟温℃	流速 m/s	大气压 kPa	截面 m ²	标干流量 m ³ /h
SUP73148208/209/210/211/ 212/213/214/215/216/218	58	7.8	100.6	0.7854	17779
SUP73148217	57	7.7	100.6	0.7854	17717
SUP73148219	56	7.9	100.5	0.7854	17990
参照标准	二氧化硫、氮氧化物、颗粒物: 《大气污染物综合排放标准》(DB 32/4041-2021) 表 1 大气污染物有组织排放限值 异丙醇、非甲烷总烃: 《半导体行业污染物排放标准》(DB 32/3747-2020) 表 3 大气 污染物排放限值				
备注: 1.“ND”表示未检出, 涉及项目检出限详见表 26。 2.“/”表示检测项目的排放浓度小于检出限, 故排放速率无需计算。 3.“---”表示 DB 32/3747-2020 表 3 标准中未对该项目作限制。 4.二氧化硫、氮氧化物为现场检测。 5. FQ-024 管道直径 1.00m, 采样孔位于弯道上游 220cm, 采样孔直径 10cm。					

本页完

主要参数与检测结果

报告编号 A2190339094179CQa001

第 29 页 共 44 页

表 16:

样品信息:								
样品类型	工业废气 (有组织)							
采样日期	2023-08-25	检测日期	2023-08-26~2023-08-30					
采样方式	连续	样品状态	完好					
检测结果:								
点位名称	检测项目	样品编号	排放浓度 mg/m ³	排放速率 kg/h	标干流量 m ³ /h	参照标准限值		排气筒 高度 m
						排放浓度 mg/m ³	排放速率 kg/h	
FQ-029	氯化氢	SUP73148151	0.65	9.81×10 ⁻⁴	868	10	---	33.5
		SUP73148152	0.80					
		SUP73148153	1.93					
		平均值	1.13					
烟气参数:								
烟气参数	烟温 °C	流速 m/s	大气压 kPa	截面 m ²	标干流量 m ³ /h			
SUP73148151/152 /153	33	2.2	100.5	0.1257	868			
参照标准	《半导体行业污染物排放标准》(DB/3747-2020) 表 3 大气污染物排放限值							
备注: “---”表示 DB/3747-2020 表 3 标准中未对该项目作限制。								

主要参数与检测结果

报告编号 A2190339094179CQa001

第 30 页 共 44 页

表 17:

样品信息:								
样品类型		工业废气 (有组织)						
采样日期		2023-08-25		检测日期		2023-08-26~2023-08-30		
采样方式		连续		样品状态		完好		
检测结果:								
点位名称	检测项目	样品编号	排放浓度 mg/m ³	排放速率 kg/h	标干流 量 m ³ /h	参照标准限值		排气 筒高 度 m
						排放浓 度 mg/m ³	排放 速率 kg/h	
FQ-049	氯化氢	SUP73148142	3.44	6.46×10 ⁻³	2083	10	---	33.5
		SUP73148143	3.90					
		SUP73148144	1.97					
		平均值	3.10					
烟气参数:								
烟气参数		烟温 °C	流速 m/s	大气压 kPa	截面 m ²	标干流量 m ³ /h		
SUP73148142/ 143/144		31	2.4	100.6	0.2827	2083		
参照标准		《半导体行业污染物排放标准》(DB 32/3747-2020) 表 3 大气污染物排放限值						
备注: “---”表示 DB 32/3747-2020 表 3 标准中未对该项目作限制。								

本页完

主要参数与检测结果

报告编号 A2190339094179CQa001

第 31 页 共 44 页

表 18:

样品信息:								
样品类型		工业废气 (有组织)						
采样日期		2023-08-26		检测日期		2023-08-27		
采样方式		连续		样品状态		完好		
检测结果:								
点位名称	检测项目	样品编号	排放浓度 mg/m ³	排放速率 kg/h	标干流量 m ³ /h	参照标准限值		排气筒 高度 m
						排放浓度 mg/m ³	排放速率 kg/h	
FQ-050	氨	SUP73148145	0.64	1.43×10 ⁻³	2428	10	---	33.5
		SUP73148146	0.54					
		SUP73148147	0.60					
		平均值	0.59					
烟气参数:								
烟气参数	烟温 °C	流速 m/s	大气压 kPa	截面 m ²	标干流量 m ³ /h			
SUP73148145	33	2.9	100.7	0.2827	2524			
SUP73148146	35	2.9	100.6	0.2827	2474			
SUP73148147	36	2.7	100.4	0.2827	2285			
参照标准	《半导体行业污染物排放标准》(DB/3747-2020) 表 3 大气污染物排放限值							
备注: “---”表示 DB/3747-2020 表 3 标准中未对该项目作限制。								

本页完

主要参数与检测结果

报告编号 A2190339094179CQa001

第 32 页 共 44 页

表 19:

样品信息:								
样品类型	工业废气 (有组织)							
采样日期	2023-08-26	检测日期	2023-08-26~2023-08-27					
采样方式	连续/瞬时	样品状态	完好					
检测结果:								
点位名称	检测项目	样品编号	排放浓度 mg/m ³	排放速率 kg/h	标干流 量 m ³ /h	参照标准限值		排气 筒高 度 m
						排放浓 度 mg/m ³	排放 速率 kg/h	
FQ-051	氨	SUP73148160	2.37	1.59×10 ⁻³	1500	10	---	33.5
		SUP73148161	0.44					
		SUP73148162	0.37					
		平均值	1.06					
	硫化氢	SUP73148166	ND	/	1182	---	1.8	
		SUP73148167	ND	/	1738			
		SUP73148168	ND	/	1580			
		最大值	ND	/	1738			
	臭气浓度	SUP73148163	549 (无量纲)		15000 (无量 纲)			
		SUP73148164	478 (无量纲)					
		SUP73148165	416 (无量纲)					
		最大值	549 (无量纲)					
烟气参数:								
烟气参数	烟温 °C	流速 m/s	大气压 kPa	截面 m ²	标干流量 m ³ /h			
SUP73148160/ 166	33	2.4	100.7	0.1590	1182			
SUP73148161/ 167	37	3.6	100.5	0.1590	1738			
SUP73148162/ 168	37	3.3	100.4	0.1590	1580			
参照标准	硫化氢、臭气浓度: 《恶臭污染物排放标准》(GB 14554-1993) 表 2 恶臭污染物 排放标准值 氨: 《半导体行业污染物排放标准》(DB 32/3747-2020) 表 3							
备注: 1.“ND”表示未检出, 涉及项目检出限详见表 26。 2.“/”表示检测项目的排放浓度小于检出限, 故排放速率无需计算。 3.“---”表示 DB 32/3747-2020 表 3 和 GB 14554-1993 表 2 标准中未对该项目作限制。								

本页完

主要参数与检测结果

报告编号 A2190339094179CQa001

第 33 页 共 44 页

表 20:

样品信息:								
样品类型	工业废气 (有组织)							
采样日期	2023-08-25	检测日期	2023-08-25~2023-08-30					
采样方式	连续/瞬时	样品状态	完好					
检测结果:								
点位名称	检测项目	样品编号	排放浓度 mg/m ³	排放速率 kg/h	标干流 量 m ³ /h	参照标准限值		排气 筒高 度 m
						排放浓 度 mg/m ³	排放 速率 kg/h	
FQ-052	异丙醇	SUP73148178	0.156	4.80×10 ⁻³	26401	40	---	33.5
		SUP73148179	0.169					
		SUP73148180	0.221					
		平均值	0.182					
	非甲烷总 烃	SUP73148175	2.19	5.17×10 ⁻²	26401	50	---	
		SUP73148176	2.29					
		SUP73148177	1.40					
		平均值	1.96					
	二氧化硫	SUP73148169	ND	/	26401	200	1.4	
		SUP73148170	ND					
		SUP73148171	ND					
		平均值	ND					
	氮氧化物	SUP73148172	3	7.92×10 ⁻²	26401	100	0.47	
		SUP73148173	3					
		SUP73148174	4					
		平均值	3					
颗粒物	SUP73148181	2.8	7.47×10 ⁻²	25763	20	1		
	SUP73148182	2.6						
	SUP73148183	3.4						
	平均值	2.9						

本页完

主要参数与检测结果

报告编号 A2190339094179CQa001

第 34 页 共 44 页

续上表

烟气参数:					
烟气参数	烟温 °C	流速 m/s	大气压 kPa	截面 m ²	标干流量 m ³ /h
SUP73148169/170/171/ 172/173/174/175/176/ 177/178/179/180/181	44	11.1	100.6	0.7854	26401
SUP73148182	42	10.8	100.6	0.7854	25868
SUP73148183	46	10.6	100.6	0.7854	25021
参照标准	二氧化硫、氮氧化物、颗粒物: 《大气污染物综合排放标准》(DB 32/4041-2021) 表 1 大气污染物有组织排放限值 异丙醇、非甲烷总烃: 《半导体行业污染物排放标准》(DB 32/3747-2020) 表 3 大气 污染物排放限值				
备注: 1.“ND”表示未检出, 涉及项目检出限详见表 26。 2.“/”表示检测项目的排放浓度小于检出限, 故排放速率无需计算。 3.“---”表示 DB 32/3747-2020 表 3 标准中未对该项目作限制。 4.二氧化硫、氮氧化物为现场检测。					

本页完

主要参数与检测结果

报告编号 A2190339094179CQa001

第 35 页 共 44 页

表 21:

样品信息:								
样品类型	工业废气 (有组织)							
采样日期	2023-08-25	检测日期	2023-08-25~2023-08-30					
采样方式	连续/瞬时	样品状态	完好					
检测结果:								
点位名称	检测项目	样品编号	排放浓度 mg/m ³	排放速率 kg/h	标干流 量 m ³ /h	参照标准限值		排气 筒高 度 m
						排放浓 度 mg/m ³	排放 速率 kg/h	
FQ-053	异丙醇	SUP73148190	0.048	1.42×10 ⁻³	21825	40	---	33.5
		SUP73148191	0.042					
		SUP73148192	0.106					
		平均值	0.065					
	非甲烷总 烃	SUP73148187	1.36	3.27×10 ⁻²	21825	50	---	
		SUP73148188	1.66					
		SUP73148189	1.48					
		平均值	1.50					
	二氧化硫	SUP73148184	ND	/	21825	200	1.4	
		SUP73148185	ND					
		SUP73148186	ND					
		平均值	ND					
	氮氧化物	SUP73148184	5	0.109	21825	100	0.47	
		SUP73148185	6					
		SUP73148186	5					
		平均值	5					
颗粒物	SUP73148193	2.7	5.66×10 ⁻²	21752	20	1		
	SUP73148194	2.6						
	SUP73148195	2.5						
	平均值	2.6						

本页完

主要参数与检测结果

报告编号 A2190339094179CQa001

第 36 页 共 44 页

续上表

烟气参数:					
烟气参数	烟温℃	流速 m/s	大气压 kPa	截面 m ²	标干流量 m ³ /h
SUP73148184/185/186/ 187/188/189/190/191/192 /193	53	9.4	100.7	0.7854	21825
SUP73148194	52	9.2	100.7	0.7854	21412
SUP73148195	57	9.6	100.7	0.7854	22020
参照标准	二氧化硫、氮氧化物、颗粒物: 《大气污染物综合排放标准》(DB 32/4041-2021) 表 1 大气污染物有组织排放限值 异丙醇、非甲烷总烃: 《半导体行业污染物排放标准》(DB 32/3747-2020) 表 3 大气 污染物排放限值				
备注: 1.“ND”表示未检出, 涉及项目检出限详见表 26。 2.“/”表示检测项目的排放浓度小于检出限, 故排放速率无需计算。 3.“---”表示 DB 32/3747-2020 表 3 标准中未对该项目作限制。 4.二氧化硫、氮氧化物为现场检测。					

本页完

主要参数与检测结果

报告编号 A2190339094179CQa001

第 37 页 共 44 页

表 22:

样品信息:								
样品类型		工业废气 (有组织)						
采样日期		2023-08-26		检测日期		2023-08-27		
采样方式		连续		样品状态		完好		
检测结果:								
点位名称	检测项目	样品编号	排放浓度 mg/m ³	排放速率 kg/h	标干流量 m ³ /h	参照标准限值		排气筒 高度 m
						排放浓度 mg/m ³	排放速率 kg/h	
FQ-060	氨	SUP73148148	0.58	5.12×10 ⁻⁴	1163	10	---	33.5
		SUP73148149	0.38					
		SUP73148150	0.37					
		平均值	0.44					
烟气参数:								
烟气参数	烟温 °C	流速 m/s	大气压 kPa	截面 m ²	标干流量 m ³ /h			
SUP73148148	40	5.8	100.6	0.0707	1250			
SUP73148149	44	5.6	100.6	0.0707	1192			
SUP73148150	42	4.9	100.5	0.0707	1046			
参照标准	《半导体行业污染物排放标准》(DB/3747-2020) 表 3 大气污染物排放限值							
备注: “---”表示 DB/3747-2020 表 3 标准中未对该项目作限制。								

本页完

主要参数与检测结果

报告编号 A2190339094179CQa001

第 38 页 共 44 页

表 23:

样品信息:								
样品类型	工业废气 (有组织)							
采样日期	2023-08-23	检测日期	2023-08-24~2023-08-29					
采样方式	连续	样品状态	完好					
检测结果:								
点位名称	检测项目	样品编号	排放浓度 mg/m ³	排放速率 kg/h	标干流量 m ³ /h	参照标准限值		排气筒 高度 m
						排放浓度 mg/m ³	排放速率 kg/h	
FQ-061	氯化氢	SUP73148154	0.69	2.33×10 ⁻³	3185	10	---	30
		SUP73148155	0.69					
		SUP73148156	0.80					
		平均值	0.73					
烟气参数:								
烟气参数	烟温 °C	流速 m/s	大气压 kPa	截面 m ²	标干流量 m ³ /h			
SUP73148154	33	14.6	100.3	0.0707	3190			
SUP73148155	33	14.6	100.3	0.0707	3190			
SUP73148156	33	14.5	100.3	0.0707	3174			
参照标准	《半导体行业污染物排放标准》(DB/3747-2020) 表 3 大气污染物排放限值							
备注: "—"表示 DB/3747-2020 表 3 标准中未对该项目作限制。								

本页完

主要参数与检测结果

报告编号 A2190339094179CQa001

第 39 页 共 44 页

表 24:

样品信息:								
样品类型	工业废气 (有组织)							
采样日期	2023-08-23	检测日期	2023-08-24~2023-08-29					
采样方式	连续	样品状态	完好					
检测结果:								
点位名称	检测项目	样品编号	排放浓度 mg/m ³	排放速率 kg/h	标干流量 m ³ /h	参照标准限值		排气筒 高度 m
						排放浓度 mg/m ³	排放速率 kg/h	
FQ-062	氯化氢	SUP73148157	0.84	3.74×10 ⁻³	2948	10	---	30
		SUP73148158	0.92					
		SUP73148159	2.06					
		平均值	1.27					
烟气参数:								
烟气参数	烟温 °C	流速 m/s	大气压 kPa	截面 m ²	标干流量 m ³ /h			
SUP73148157/158 /159	34	13.5	100.4	0.0707	2948			
参照标准	《半导体行业污染物排放标准》(DB/3747-2020) 表 3 大气污染物排放限值							
备注: “---”表示 DB/3747-2020 表 3 标准中未对该项目作限制。								

本页完

主要参数与检测结果

报告编号 A2190339094179CQa001

第 40 页 共 44 页

表 25:

仪器信息:					
检测项目		对应仪器			
		名称	型号	实验室编号	检校有效期
工业废气 (有组织)	氟化物	自动烟尘烟气综合测试仪	ZR-3260	TTE20200007	2024-01-02
		自动烟尘烟气综合测试仪	ZR-3260	TTE20202495	2023-08-30
		离子计	PXSJ-216F	TTE20213340	2023-09-27
		低浓度自动烟尘烟气综合测试仪	ZR-3260D 型	TTE20222632	2024-07-02
	颗粒物	电子天平	BT 125D	TTE20100253	2024-07-03
		自动烟尘烟气综合测试仪	ZR-3260	TTE20200007	2024-01-02
		自动烟尘烟气综合测试仪	ZR-3260	TTE20202495	2023-08-30
		低浓度自动烟尘烟气综合测试仪	ZR-3260D 型	TTE20222632	2024-07-02
	二氧化硫	自动烟尘烟气综合测试仪	ZR-3260	TTE20200007	2024-01-02
		自动烟尘烟气综合测试仪	ZR-3260	TTE20202495	2023-08-30
		低浓度自动烟尘烟气综合测试仪	ZR-3260D 型	TTE20222632	2024-07-02
	氮氧化物	自动烟尘烟气综合测试仪	ZR-3260	TTE20200007	2024-01-02
		自动烟尘烟气综合测试仪	ZR-3260	TTE20202495	2023-08-30
		低浓度自动烟尘烟气综合测试仪	ZR-3260D 型	TTE20222632	2024-07-02

本页完

主要参数与检测结果

报告编号 A2190339094179CQa001

第 41 页 共 44 页

续上表

仪器信息:					
检测项目		对应仪器			
		名称	型号	实验室编号	检校有效期
工业废气 (有组织)	氯化氢	离子色谱仪 (IC)	ICS-1100	TTE20120654	2024-04-14
		离子色谱仪 (IC)	Aquion	TTE20164915	2024-07-21
		自动烟尘烟气综合测试仪	ZR-3260	TTE20200007	2024-01-02
		自动烟尘烟气综合测试仪	ZR-3260	TTE20202495	2023-08-30
		自动烟尘烟气综合测试仪	ZR-3260	TTE20202496	2023-08-30
		双路烟气采样器	ZR-3712	TTE20212467	2023-08-30
		低浓度自动烟尘烟气综合测试仪	ZR-3260D 型	TTE20222632	2024-07-02
		吸附管法双路环境空气 VOCs 采样仪	2061 型	TTE20224474	2023-11-02
		阻容法烟气含湿量多功能检测器	崂应 1062D 型	TTE20232548	2024-05-31
	多路烟气采样器	ZR-3714	TTE20234508	2024-08-07	
	硫酸雾	离子色谱仪 (IC)	Aquion	TTE20164915	2024-07-21
		自动烟尘烟气综合测试仪	ZR-3260	TTE20200007	2024-01-02
		自动烟尘烟气综合测试仪	ZR-3260	TTE20202495	2023-08-30
		低浓度自动烟尘烟气综合测试仪	ZR-3260D 型	TTE20222632	2024-07-02

本页完

主要参数与检测结果

报告编号 A2190339094179CQa001

第 42 页 共 44 页

续上表

仪器信息:					
检测项目		对应仪器			
		名称	型号	实验室编号	检校有效期
工业废气 (有组织)	氯气	自动烟尘烟气综合测试仪	ZR-3260	TTE20200007	2024-01-02
		自动烟尘烟气综合测试仪	ZR-3260	TTE20202495	2023-08-30
		双路烟气采样器	ZR-3712	TTE20212467	2023-08-30
		紫外可见分光光度计 (UV)	UV-7504	TTE20213126	2023-09-27
		双路 VOCs 采样器	ZR-3713	TTE20221880	2024-06-18
		低浓度自动烟尘烟气综合测试仪	ZR-3260D 型	TTE20222632	2024-07-02
		吸附管法双路环境空气 VOCs 采样仪	2061 型	TTE20224474	2023-11-02
		多路烟气采样器	ZR-3714	TTE20234508	2024-08-07
	非甲烷总烃	气相色谱仪 (GC)	GC-2014	TTE20172480	2024-03-15
		自动烟尘烟气综合测试仪	ZR-3260	TTE20200007	2024-01-02
		自动烟尘烟气综合测试仪	ZR-3260	TTE20202495	2023-08-30
		低浓度自动烟尘烟气综合测试仪	ZR-3260D 型	TTE20222632	2024-07-02
	硫化氢	双路烟气采样器	ZR-3712	TTE20212467	2023-08-30
		紫外可见分光光度计 (UV)	UV-7504	TTE20213126	2023-09-27
		阻容法烟气含湿量多功能检测器	崂应 1062D 型	TTE20232548	2024-05-31

本页完

主要参数与检测结果

报告编号 A2190339094179CQa001

第 43 页 共 44 页

续上表

仪器信息:					
检测项目		对应仪器			
		名称	型号	实验室编号	检校有效期
工业废气 (有组织)	氨	双路烟气采样器	ZR-3712	TTE20212467	2023-08-30
		紫外可见分光光度计 (UV)	UV-7504	TTE20213126	2023-09-27
		吸附管法双路环境空气 VOCs 采样仪	2061 型	TTE20224474	2023-11-02
		阻容法烟气含湿量多功能检测器	崂应 1062D 型	TTE20232548	2024-05-31
	异丙醇	气相色谱质谱联用仪 (GCMS)	QP-2010Ultra	TTE20150799	2024-04-19
		自动烟尘烟气综合测试仪	ZR-3260	TTE20200007	2024-01-02
		自动烟尘烟气综合测试仪	ZR-3260	TTE20202495	2023-08-30
		低浓度自动烟尘烟气综合测试仪	ZR-3260D 型	TTE20222632	2024-07-02
		吸附管法双路环境空气 VOCs 采样仪	2061 型	TTE20224474	2023-11-02
		多路烟气采样器	ZR-3714	TTE20234508	2024-08-07

本页完

主要参数与检测结果

报告编号 A2190339094179CQa001

第 44 页 共 44 页

表 26:

检测方法 & 检出限:			
类别	项目	标准 (方法) 名称及编号 (含年号)	检出限
工业废气 (有组织)	氟化物	大气固定污染源 氟化物的测定 离子选择电极法 HJ/T 67-2001	0.06mg/m ³
	颗粒物	固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ 836-2017	1.0mg/m ³
	二氧化硫	固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ 57-2017	3mg/m ³
	氮氧化物	固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014	3mg/m ³
	氯化氢	环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法 HJ 549-2016	0.2mg/m ³
	硫酸雾	固定污染源废气 硫酸雾的测定 离子色谱法 HJ 544-2016	0.2mg/m ³
	氯气	固定污染源排气中氯气的测定 甲基橙分光光度法 HJ/T 30-1999	0.2mg/m ³
	非甲烷总烃	固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ 38-2017	0.07mg/m ³
	硫化氢	《空气和废气监测分析方法》(国家环保总局 2003 年 第四版 增补版) 第五篇 第四章 十 (三)	0.01mg/m ³
	氨	环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009	0.25mg/m ³
	臭气浓度	环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法 HJ 1262-2022	/
异丙醇	固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 734-2014	0.002mg/m ³	

报告结束